



Study of surface phenomena acting during ion beam oxidation of semiconductor and chemical etching of ultra-thin oxides [

Alay, Josep Lluís

Publicacions Universitat de Barcelona,
1992

Monografia

<https://rebiunoda.pro.baratznet.cloud:38443/OpacDiscovery/public/catalog/detail/b2FpOmNlbGVicmF0aW9uOmVzLmJhcmF0ei5yZW4vMjc5NTMzNTk>

Título: Study of surface phenomena acting during ion beam oxidation of semiconductor and chemical etching of ultra-thin oxides Microforma] Josep Lluís Alay i Rodríguez

Editorial: Barcelona Publicacions Universitat de Barcelona 1992

Descripción física: 1 microfita 11x15 cm + 1 fullet (9 p. ; 16 cm)

Mención de serie: Col·lecció de tesis doctorals microfita 2309

Nota general: A la contraportada: Divisió: Ciències Experimentals i Matemàtiques. Departament: Física Aplicada i Electrònica

Tesis: Tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 1993

Bibliografía: Bibliografia

Copyright/Depósito Legal: B 9351-1995 Biblioteca de Catalunya

ISBN: 844750719X

Materia: Superfícies (Tecnologia) Oxidació Semiconductors Espectroscòpia de raigs X. Superfícies Semiconductors Espectroscòpia de raigs X.

Entidades: Universidad de Barcelona. Departament de Física Aplicada i Electrònica

Punto acceso adicional serie-Título: Col·lecció de tesis doctorals microfita 2309

Baratz Innovación Documental

- Gran Vía, 59 28013 Madrid
- (+34) 91 456 03 60
- informa@baratz.es